INTERNATIONAL STANDARD

ISO 16531

Second edition
2020-10

Surface chemical analysis — Depth profiling — Methods for ion beam alignment and the associated measurement of current or current density for depth profiling in AES and XPS

Analyse chimique des surfaces — Profilage d'épaisseur — Méthodes d'alignement du faisceau d'ions et la mesure associée de densité de courant ou de courant pour le profilage d'épaisseur en AES et XPS

Reference number
ISO 16531:2020(E)

© ISO 2020

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn